

Inhalt

		Seite
<i>R. Feiertag</i>	Technischer Wandel durch Mikrotechnik	1
<i>N. Brackmann</i>	Marktbedeutung der Mikrotechnik	19
<i>J. Engemann</i>	Schichtaufbau- und Oberflächenmodifikation durch plasma- und ionengestützte Prozesse	51
<i>W. Hedderich</i>	Herstellung, Charakterisierung und Anwendungen von Diamantschichten	73
<i>J. Tümpner</i>	Massenspektroskopische und elektronenspektroskopische Verfahren zur Analyse dünner Schichten	89
<i>W. Menz</i>	Aspekte der Mikrosystemtechnik	99
<i>G. Tschulena</i>	Moderne Miniaturisierungstechniken für Sensoren	107
<i>H.-J. Gevatter</i>	Fehlerkompensation mikromechanisch hergestellter Beschleunigungssensoren	125
<i>R. Einzinger</i>	Großformatige α -Si-H-Lesezeilen für Dokumenten-Scanner	135
<i>H. Grethen</i>	Planar-Kontaktscanner	165
<i>W. Pekruhn</i>	Modell zur Optimierung der Leistungsmerkmale des Thermostransfer-Druckes	183
<i>K. Weingand</i>	Großformatige Druckkämme	197
<i>G. Gleske</i>	Flüssigkristall-Anzeigen	211
<i>H. Rieger</i>	Ferroelektrische Flüssigkristallzellen	221
<i>A. E. F. Wächter</i>	Flüssigkristallwerkstoffe	235